АНТИГИСТЕРЕЗИС СОПРОТИВЛЕНИЯ ГРАФЕНА НА ПОДЛОЖКЕ СЕГНЕТОЭЛЕКТРИКА $Pb(Zr_xTi_{1-x})O_3$

А. И. Курчак, М. В. Стриха^{*}

Институт физики полупроводников им. В. Е. Лашкарева Национальной академии наук Украины 03039, Киев, Украина

Поступила в редакцию 22 мая 2012 г.

Построена количественная модель для объяснения антигистерезисного поведения сопротивления графена на подложке из сегнетоэлектрика $\operatorname{Pb}(\operatorname{Zr}_x\operatorname{Ti}_{1-x})O_3$ с изменением напряжения на затворе. Модель учитывает захват электронов из слоя графена на состояния, связанные с интерфейсом графенсегнетоэлектрик. При этом учтена конечная энергетическая ширина зоны примесных состояний, что позволило описать полученные ранее экспериментальные зависимости, включая увеличение, а затем насыщение «окна памяти» с увеличением переключающего напряжения на затворе. Сделанные оценки могут быть важны при создании элементов энергонезависимой памяти нового поколения, использующих возникающие в результате эффекта антигистерезиса два стабильных значения сопротивления, одному из которых соотносят логический «0», а второму — «1».

DOI: 10.7868/S0044451013010129

1. ВВЕДЕНИЕ

Графен на подложке сегнетоэлектрика интенсивно изучают на протяжении последних лет (см. обзор [1] и ссылки в нем). Во-первых, такая подложка с высокой диэлектрической проницаемостью к позволяет получить значения концентрации носителей в графене, на порядки превышающие те, которые были получены на традиционной подложке из SiO_2 с $\kappa = 3.9$, а во-вторых, наличие гистерезиса в зависимости поляризации сегнетоэлектрика от величины приложенного поля позволяет создавать четко различаемые состояния с разным сопротивлением графенового «канала» (состояния «0» и «1» для логических элементов). Впервые такой логический элемент был создан на основе графена на подложке жидкокристаллического сегнетоэлектрика поливинилэден флюорид трифлуороэтилен (PVDF-TrFE) [2]. В дальнейшем технология таких элементов была усовершенствована [3, 4]. Однако их недостатком, с точки зрения практического применения, является необходимость значительных переключающих напряжений на затворе (несколько десятков вольт), что является следствием большой величины коэрцитивного поля, необходимого для из-

*E-mail: maksym_strikha@hotmail.com

менения направления поляризации сегнетоэлектрика PVDF-TrFE.

Удачной альтернативой оказалось использование в качестве подложки сегнетоэлектрической керамики Pb(Zr_xTi_{1-x})O₃ (PZT). Такая подложка высокотехнологична и обладает очень высокой диэлектрической проницаемостью (до 3850 [5] вблизи морфотропной границы фаз при x = 0.52). К настоящему времени на основе одно- и многослойного графена на подложке PZT уже созданы достаточно надежные системы с двумя устойчивыми состояниями [6-8], которые могут быть положены в основу работы элементов сегнетоэлектрической энергонезависимой памяти нового поколения. Также показана возможность создания на основе графена на сегнетоэлектрической подложке эффективного модулятора излучения близкого и среднего ИК-диапазонов для оптических соединений на чипах [9].

Однако наблюдаемая в работах [6–8] (причем независимо от числа слоев графена (n = 1-15), подвижности носителей (1600–140000 см²/В·с) и диэлектрической проницаемости слоя РZТ (30–500)) гистерезисная зависимость проводимости графенового канала от напряжения на затворе обладала по крайней мере двумя необычными особенностями. Во-первых, направление обхода петли гистерезиса оказалось противоположным тому, которое следовало бы ожидать исходя из представлений об изменении поляризации собственно поверхностных диполей сегнетоэлектрика. Во-вторых, переключение системы происходило при напряжениях на затворе, существенно (на порядок и более) меньших, чем те, которые соответствовали бы коэрцитивному полю сегнетоэлектрика (что было исключительно хорошо для применения эффекта в реальных элементах энергонезависимой памяти).

До появления работы [10] отсутствовала не только численная модель для описания необычного вида гистерезиса в зависимости сопротивления графена от напряжения на затворе, наблюдаемого в работах [6-8], но и исчерпывающее качественное понимание эффекта, который был назван в этих работах «антигистерезисом». В работе [10] была предложена модель, учитывающая захват носителей состояниями на интерфейсе графен-сегнетоэлектрик и экранирование их зарядом электрического поля в подложке (с соответствующим уменьшением концентрации свободных носителей в графене). Такая простая модель позволила удовлетворительно качественно описать поведение сопротивления графенового канала с изменением напряжения на затворе, наблюдаемое в эксперименте [6].

Однако в работе [10] были сделаны упрощающие предположения о δ -образном виде уровней интерфейсных состояний по шкале энергии и о мгновенном захвате свободных носителей из графена на эти состояния, когда уровень Ферми в легированном графене достигает энергии носителей. Как будет показано ниже, учет «размытости» этих состояний по энергетической шкале не только позволяет сделать вывод о невозможности мгновенного захвата, но и объясняет увеличение, а в дальнейшем насыщение «окна памяти» системы графен-сегнетоэлектрик-затвор с увеличением переключающего напряжения на затворе, наблюдаемое экспериментально [7, 8].

Наша работа изложена следующим образом. В разд. 2 построена теоретическая модель явления антигистерезиса в зависимости концентрации свободных носителей в графеновом канале на подложке из сегнетоэлектрика PZT от напряжения на затворе. В разд. 3 рассмотрено ее соответствие имеющимся в литературе экспериментальным данным, сопоставлены экспериментальные и теоретические зависимости удельного сопротивления графенового канала от напряжения на затворе и «окна памяти» от переключающего напряжения. В выводах обсуждены пределы применимости предложенной модели.



Рис. 1. Энергетический спектр графена и плотность ho(E) локализованных состояний, связанных с интерфейсом графен-сегнетоэлектрик

2. МОДЕЛЬ ЯВЛЕНИЯ АНТИГИСТЕРЕЗИСА В ЗАВИСИМОСТИ КОНЦЕНТРАЦИИ НОСИТЕЛЕЙ В ГРАФЕНОВОМ КАНАЛЕ НА ПОДЛОЖКЕ РZT ОТ НАПРЯЖЕНИЯ НА ЗАТВОРЕ

В дальнейшем будем рассматривать моноатомный слой легированного напряжением на затворе графена, в котором зависимость энергии Ферми от концентрации *n* свободных носителей задается известным соотношением

$$E_F = \hbar v_F \sqrt{\pi n} \,, \tag{1}$$

где скорость Ферми $v_F = 10^8 \, {
m cm/c}.$

Предположим, что на интерфейсе графен-подложка существуют локализованные состояния с энергией, описываемой плотностью состояний $\rho_T(E)$. При этом также предположим, что величина $\rho_T(E)$ отлична от нуля только в некотором интервале $E_{T1} < E < E_{T2}$, а вне этой зоны примесных состояний она нулевая (рис. 1). При увеличении напряжения на затворе V_g в диапазоне, для которого $E_F < E_{T1}$, концентрация носителей в слое графена определяется простым соотношением, являющимся следствием формулы для плоского конденсатора:

$$n = \kappa V_g / 4\pi ed, \tag{2}$$

где d — толщина подложки. Однако при $E_F = E_{T1}$ электроны из слоя графена начинают заполнять интерфейсные состояния, имеющие поверхностную концентрацию n_T ,

$$n_T = \int_{E_{T1}}^{E_{T2}} \rho_T(E) \, dE.$$
 (3)

Отрицательный заряд, связанный на заполненных интерфейсных состояниях, экранирует поле в подложке, и правой части выражения (2) будет теперь отвечать суммарная концентрация связанных носителей на интерфейсных состояниях и свободных носителей в слое графена. Поэтому при дальнейшем увеличении V_g концентрация свободных носителей в легированном графене как функция напряжения на затворе будет описываться уравнением

$$n(V_g) = \frac{\kappa V_g}{4\pi e d} - \int_{E_{T_1}}^{E_F(n(V_g))} \rho_T(E) \, dE.$$
(4)

Отметим, что в верхнем пределе интеграла в правой части выражения (4) стоит энергия Ферми, зависящая от искомой концентрации $n(V_g)$ через соотношение (1). Для дальнейшего решения уравнения следует знать вид плотности состояний $\rho_T(E)$. К сожалению, экспериментальные работы, посвященные микроскопической структуре состояний на интерфейсе графен-керамика РZT к настоящему времени отсутствуют. Поэтому сделаем наиболее простое предположение: эта плотность постоянна в рамках энергетического интервала $E_{T1} < E < E_{T2}$ (и нулевая вне его). Исходя из этого предположения, из выражения (3) получаем

$$\rho_T(E) = n_T / \Delta E, \quad \Delta E \equiv E_{T2} - E_{T1}. \tag{5}$$

Подставив соотношение (5) в (4), получим в аналитическом виде решения уравнения для двух областей. В первой из них,

$$\frac{4\pi ed}{\kappa} \frac{E_{T1}^2}{\pi \hbar^2 v_F^2} \le V_g < \frac{4\pi ed}{\kappa} \frac{E_{T2}^2}{\pi \hbar^2 v_F^2} + \frac{4\pi edn_T}{\kappa}, \quad (6)$$

происходит заполнение интерфейсных состояний свободными носителями из легированного графена. В этой области

$$n = \left[-\frac{n_T \sqrt{\pi} \hbar v_F}{2\Delta E} + \sqrt{\frac{n_T^2 \pi \hbar^2 v_F^2}{4\Delta E^2} + \frac{n_T E_{T1}}{\Delta E} + \frac{\kappa V_g}{4\pi e d}} \right]^2.$$
(7)

Как видно из выражения (7), при достаточно малой ширине энергетического промежутка ΔE и достаточно большой концентрации n_T имеет место простое соотношение

$$n \approx \frac{E_{T1}}{\sqrt{\pi}\,\hbar v_F} + \frac{\kappa V_g}{4\pi e d} \,\frac{\Delta E}{n_T \sqrt{\pi}\,\hbar v_F},\tag{8}$$

и, таким образом, концентрация свободных носителей в графене остается практически постоянной и почти не зависит от напряжения на затворе до завершения заполнения интерфейсных состояний. Этот результат существенно модифицирует простое предположение о мгновенном захвате носителей на интерфейсные состояния, использованное в работе [10].

В области более высоких напряжений на затворе, когда все интерфейсные состояния уже заполнены электронами,

$$\frac{4\pi ed}{\kappa} \frac{E_{T2}^2}{\pi \hbar^2 v_F^2} + \frac{4\pi edn_T}{\kappa} \le V_g,\tag{9}$$

уравнение (4) имеет очевидное решение:

$$n(V_g) = \frac{\kappa V_g}{4\pi e d} - n_T.$$
(10)

Дальнейшим нашим предположением, как и в работе [10], является то, что время жизни электронов на интерфейсных состояниях значительно превосходит время переключения системы. Поэтому соотношение (9) справедливо и при дальнейшем уменьшении напряжения на затворе: ведь носители, захваченные на состояния, на них и остаются, хотя уровень Ферми в графене уже находится ниже этих состояний по энергетической шкале.

Таким образом, зависимость концентрации n от напряжения V_g будет иметь вид, изображенный на рис. 2 (кривые 1 для увеличения напряжения и 2 для его уменьшения, стрелки указывают увеличение или уменьшение напряжения; зависимости от напряжения переключения, представленные на рис. 2a-e, будут обсуждены ниже). Кривая 2 достигает точки электронейтральности (точки Дирака) при напряжении V_{DP} , определяемом концентрацией состояний n_T :

$$V_{DP} = 4\pi e dn_T / \kappa. \tag{11}$$

Отметим, что слева от точек Дирака кривые 1, 2 на рис. 2 соответствуют концентрациям дырок. При некотором большом отрицательном напряжении V_g (величина которого зависит от модели локализованных состояний) захваченные электроны в конце концов прорекомбинируют с дырками в слое графена. К сожалению, данные о микроскопической природе потенциала уровня, которые позволили бы построить более точную модель такого процесса, отсутствуют. Поэтому остается предположить, что зависимость концентрации *n* свободных носителей от напряжения на затворе будет иметь вид, симметричный относительно точки $V_{DP}/2$: при некотором значении



Рис.2. Гистерезис в зависимости концентрации свободных носителей в легированном графене на подложке РZT от напряжения на затворе. Значения параметров, отвечающих рис. 2a-d, указаны в тексте. Стрелки показывают направление обхода петли гистерезиса

отрицательного напряжения начнется опустошение уровня, а при значении, большем на величину порядка V_{DP} , оно завершится. Тогда зависимость концентрации от напряжения снова приобретет вид (2). Таким образом, петля гистерезиса в зависимости концентрации от напряжения на затворе замкнется.

Понятно, что если диапазон изменения напряжения на затворе мал (т.е. выполняется условие $E_F < E_{T1}$), то концентрация всегда соответствует кривой 1 и никакого гистерезиса не наблюдается (рис. 2*a*). Особый интерес приобретает случай, когда напряжение переключения V_{sweep} лежит в интервале (6), т.е. когда заполнение уровня еще не завершено. При этом кривая антигистерезиса «расширяется», а точки электронейтральности отдаляются друг от друга по шкале напряжений с увеличением V_{sweep} . Расстояние между ними теперь определяется соотношением

$$V_{DP}(V_{sweep}) = 4\pi e dn_T(V_{sweep})/\kappa, \qquad (12)$$

где $n_T(V_{sweep})$ — концентрация интерфейсных состояний, которые оказались заполненными электронами к моменту переключения:

$$n_T(V_{sweep}) = \int_{E_{T1}}^{E_F(n(V_{sweep}))} \rho_T(E) \, dE.$$
(13)

Отметим, что именно величина (12) — расстояние по шкале напряжений на затворе между двумя последовательными прохождениями точки электронейтральности — определяет «окно памяти» системы [8]. Из выражений (12), (13) видно, что окно памяти увеличивается с увеличением напряжения на затворе и в конце концов достигает насыщения, когда напряжение переключения попадает в область (9) и все интерфейсные состояния уже заполнены электронами. Именно такую зависимость демонстрировало «окно памяти» в работах [7, 8].

Рисунок 2 иллюстрирует это увеличение окна памяти. Зависимости рассчитаны для значений параметров $\kappa = 400, d = 300$ нм, $n_T = 7.37 \cdot 10^{10}$ см⁻² (a), $1.77 \cdot 10^{12}$ см⁻² (б), $6.4 \cdot 10^{12}$ см⁻² (e), $1.54 \cdot 10^{13}$ см⁻² (e), $4.76 \cdot 10^{13}$ см⁻² (d), $E_{T1} = 0.3$ эВ, $\Delta E = 0.005$ эВ. При этом, поскольку для оценок нами взято малое значение ширины зоны ΔE примесных состояний, полученные численно зависимости в пределах интервала напряжений на затворе (7), где происходит заполнение примесного уровня, имеют вид ровного плато, описываемого выражением (8). Поскольку концентрация состояний от рис. 2a к рис. 2d растет, увеличивается и интервал напряжений (6), необходимый для заполнения этих состояний электронами из слоя графена.

3. АНТИГИСТЕРЕЗИС В ЗАВИСИМОСТИ СОПРОТИВЛЕНИЯ ГРАФЕНОВОГО КАНАЛА ОТ НАПРЯЖЕНИЯ НА ЗАТВОРЕ: СРАВНЕНИЕ С ЭКСПЕРИМЕНТОМ

Гистерезису в зависимости концентрации от напряжения на затворе должен соответствовать гистерезис в аналогичной зависимости полного удельного сопротивления (напомним: в двумерной структуре оно имеет размерность Ом). Действительно, полное удельное сопротивление слоя графена обратно пропорционально его проводимости:

$$\rho(V_g) \approx \frac{1}{\sigma(V_g) + \sigma_{intr}(T) + \sigma_{min}} \,. \tag{14}$$

Здесь первое слагаемое в знаменателе отвечает проводимости легированного графена,

$$\sigma(V_q) = en\mu,\tag{15}$$

где концентрация n определяется зависимостями от V_g , полученными выше, а μ — подвижность носителей. Второе слагаемое в знаменателе выражения (14) описывает проводимость σ_{intr} собственно графена, и его нужно учитывать, когда уровень Ферми находится вблизи точки электронейтральности. Напомним, что концентрация носителей в собственно графене зависит от температуры T:

$$n_{intr}(T) = \frac{2(kT)^2}{\pi(\hbar v_F)^2},$$
(16)

где k — постоянная Больцмана. Согласно (16), комнатной температуре соответствует концентрация $n_{intr} \approx 1.1 \cdot 10^{11}$ см⁻². Поэтому для подложки толщиной около 300 нм и с диэлектрической проницаемостью $\kappa \approx 400$ это слагаемое следует учитывать в области вблизи точки электронейтральности шириной порядка ±0.1 В. В этой области по шкале напряжений на затворе такая проводимость сопоставима с описываемой выражением (15). Наконец, величина $\sigma_{min} \approx 4e^2/\hbar$ отвечает минимальной проводимости вблизи точки Дирака, которая имеет квантовую природу (см., например, [11]).

Расчетная зависимость $\rho(V_q)$ изображена на рис. 3 (кривые 1 для увеличения напряжения и 2 для его уменьшения, стрелки также указывают увеличение или уменьшение напряжения, параметры для кривых на рис. За-д для концентраций легирования отвечают такие же, как для рис. 2*a*-*d*, температура комнатная, подвижность мы полагали равной $\mu = 4900 \text{ см}^2 / \text{B} \cdot \text{c}$, что лежит в пределах значений для образцов, исследованных в работах [7,8]). Как видно, нами получены кривые антигистерезиса, поведение которых соответствует результатам работ [6-8] (см. рис. За в работе [7]). При этом модель не объясняет некоторой асимметричности пиков сопротивления, наблюдаемой экспериментально и связанной, очевидно, с химическим легированием графена в области нанесения контактов.

На рис. 4 изображены экспериментальная [8] и теоретическая (рассчитанная с помощью выражений (12), (13)) зависимости «окна памяти» от переключающего напряжения на затворе (экспериментальной ситуации отвечают значения $\kappa = 500, d =$ = 180 нм). Как видно, хорошего совпадения кривых удается достичь при параметрах $E_{T1} = 0.45$ эВ, $\Delta E = 0.11$ эВ, $n_T = 10^{13}$ см⁻². При этом «подгоночными» являлись только два последних параметра,



Рис. 3. «Антигистерезис» в зависимости удельного сопротивления графенового канала от напряжения на затворе. Значения параметров, отвечающих рис. *a*-*d*, те же, что и для рис. 2*a*-*d*. Стрелки показывают направление обхода петли гистерезиса

поскольку значение энергии нижнего края зонных состояний легко найти из значения напряжения переключения на затворе, которому соответствует переход от ситуации без гистерезиса (рис. 3a) к началу заполнения интерфейсных состояний (рис. 3b).

Как видно из сравнения теоретических и экспериментальных кривых, предложенная модель описывает не только явление антигистерезиса в зависимости удельного сопротивления (тока) от напряжения на затворе, но и экспериментально наблюдаемое увеличение, а затем насыщение «окна памяти» с увеличением напряжения переключения системы. Отметим, что в рамках простого приближения δ-образного уровня объяснить это не представ-



Рис. 4. Зависимость «окна памяти» от напряжения переключения на затворе (точки — экспериментальные данные [8], сплошная линия — теория)

лялось возможным. Более того, использование модели может дать количественные представления о параметрах интерфейсных состояний.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мы использовали набор стандартных предположений, применяемых в физике графена. Отметим, что формула (2) применима к достаточно «толстым» (толщиной более нескольких ангстрем) подложкам, когда можно пренебречь слагаемым, связанным с «квантовой емкостью» [11]. Однако, поскольку весь набор описанных в работах [2–4, 6–8] экспериментальных ситуаций связан с подложками субмикронной толщины, такое приближение является вполне оправданным.

Релаксация антигистерезиса, наблюдаемая в эксперименте [6], может быть объяснена конечностью времени жизни электронов на интерфейсных состояниях. Однако такое время жизни может быть рассчитано лишь исходя из некоторой микроскопической модели, которая, в свою очередь, требует информации о физической природе состояний. К сожалению, к настоящему времени такая информация в достаточном объеме отсутствует.

Предположение о длительности нахождения электронов на интерфейсных состояниях по сравнению со временем переключения системы оправдано. В современных устройствах энергонезависимой памяти время переключения может составлять величину порядка пикосекунд. В то же время в работе [6] было показано, что эффект самопроизвольного заполнения/опустошения интерфейсных состояний (с туннелированием через барьер) характеризуется длительными временами релаксации. Такое время τ возрастало от 6 ч при 300 К до 80 дн при азотной температуре. Рассматривая процесс как термически активированную релаксацию, описываемую соотношением $1/\tau \propto \exp[-\Delta E/kT]$, можно оценить энергию активации $\Delta E \approx 50$ –110 мэВ.

Отметим также, что в проведенном простом рассмотрении мы фактически пренебрегли собственным гистерезисом в зависимости поляризации сегнетоэлектрика PZT от приложенного поля. Это приближение справедливо лишь в области малых V_g , соответствующих значениям n, значительно меньшим, чем номинальная двумерная концентрация носителей заряда, отвечающая поляризации PZT и равная $3 \cdot 10^{14}$ см⁻² [6]. При таких малых напряжениях на затворе сегнетоэлектрик может быть приближенно рассмотрен как диэлектрик с очень высоким значением диэлектрической проницаемости κ .

Полученные оценочные значения концентрации интерфейсных состояний являются не слишком большими, поскольку имеются экспериментальные свидетельства значительно больших поверхностных концентраций таких состояний для сегнетоэлектрика [12].

Предложенная простая модель, учитывающая экранирование электрического поля в подложке зарядом электронов, захваченных состояниями на интерфейсе графен–сегнетоэлектрик, позволяет удовлетворительно объяснить наблюдаемое явление антигистерезиса в зависимости удельного сопротивления графена от напряжения на затворе, а также насыщение «окна памяти» с увеличением напряжения переключения.

Поскольку на основе эффекта антигистерезиса в системе «графен на РZT-подложке» предложено создание ячеек энергонезависимой памяти (состояния с минимальным значением сопротивления графенового канала отвечают «О», с максимальным — «1»), рассмотренная модель может быть важна для расчета параметров оперативных запоминающих устройств (FRAM) нового поколения. В частности, показано, что эффект антигистерезиса в зависимости концентрации носителей в канале легированного графена на подложке PZT от напряжения на затворе приводит к антигистерезису не только в соответствующей зависимости сопротивления, но и в зависимостях оптических характеристик (в первую очередь, коэффициента отражения [13]). Поэтому на основе рассмотренной системы

графен-сегнетоэлектрик-затвор могут быть созданы не только электрофизические, но и оптические системы с двумя устойчивыми состояниями.

В свою очередь, можно рассчитывать, что полученные результаты приведут к интенсификации изучения локализованных состояний на интерфейсе графен-сегнетоэлектрическая керамика PZT.

Работа выполнена при финансовой поддержке Государственного фонда фундаментальных исследований Украины в рамках выполнения совместного украино-российского проекта. Авторы также благодарны В. Г. Литовченко за постоянное внимание к этой работе.

ЛИТЕРАТУРА

- M. V. Strikha, Ukr. J. Phys. Opt. 13, Suppl. 3 Sci. Horiz., S5 (2012).
- Yi Zheng, G.-X. Ni, C.-T. Toh et al., Appl. Phys. Lett. 94, 163505 (2009).
- Yi Zheng, G.-X. Ni, C.-T. Toh et al., Phys. Rev. Lett. 105, 166602 (2010).

- S. Raghavan, I. Stolichnov, N. Setter et al., Appl. Phys. Lett. 100, 023507 (2012).
- J. Rouquette, J. Haines, V. Bornand et al., Phys. Rev. B 70, 014108 (2004).
- X. Hong, J. Hoffman, A. Posadas et al., Appl. Phys. Lett. 97, 033114 (2010).
- Yi Zheng, Guang-Xin Ni, Sukang Bae et al., Europhys. Lett. 93, 17002 (2011).
- Emil B. Song, Bob Lian, Sung Min Kim et al., Appl. Phys. Lett. 99, 042109 (2011).
- 9. M. V. Strikha, Ukr. J. Phys. Opt. 12, 162 (2011).
- **10**. М. В. Стриха, Письма в ЖЭТФ **95**, 216 (2012).
- S. Das Sarma, Shaffique Adam, E. H. Hwang, and Enrico Rossi, Rev. Mod. Phys. 83, 407 (2011).
- A. Ohtomo, D. A. Muller, J. L. Grazul, and H. Y. Hwang, Nature 419, 378 (2002).
- 13. M. V. Strikha, Ukr. J. Phys. Opt. 13, 45 (2012).